

# 「ナノファブスクエア」開催案内

新川崎・創造のもりのNANOBIICオープンラボ  
ナノ・マイクロ技術講習・実習会

回	プロセス	実習で利用する装置（材料）	日程
1	超解像度レーザー顕微鏡	超解像度レーザー顕微鏡	2018/5/17(木)
2	フォトマスク作製	レーザ描画装置	5/31(木)
3	精密リソグラフィ	両面マスクアライナ	仮 6/28(木)
4	加工表面観察	超高解像度表面形状計測装置、触針式段差計	仮 7/12(木)
5	シリコンドライエッチング	シリコン深堀りDRIE装置	仮 7/26(木)
6	レジスト塗布	コータデベロッパ装置、スピスコータ	8/8(水)
7	マイクロモルディング	レーザ描画装置	仮 8/30(木)
8	ガラスエッチング	高密度プラズマドライエッチング装置	9/20(木)
9	金属薄膜形成 (1)	ECR スパッタ	9/27(木)
10	パリレン薄膜形成	パリレン蒸着装置	10/25(木)
11	金属薄膜形成 (2)	4元マグネトロンサイドスパッタ	11/8(木)
12	ウェットエッチング	ドラフト	仮 11/15(木)
13	ウェーハ切断	ダイシングソー	仮 11/22(木)
14	デバイス接合	プラズマ発生装置	仮 12/6(木)
15	3次元加工構造観察	レーザ顕微鏡、3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡	仮 12/20(木)

## 場所

かわさき新産業創造センター（KBIC）新館 NANOBIIC  
川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり（JR新川崎駅から徒歩10分）

## 実習概要

マイクロ流路の一連の試作を、シリコン、ガラス、樹脂を使い実施し、表面形態の観察・評価までを行うプログラムにより、目的に応じた受講が可能です

主催：4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム  
（地独）神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、川崎市

共催：次世代マイクロ化学チップコンソーシアム

定員：5名程度(先着) 費用：原則実費（個別チラシに費用を掲載）を負担いただきます。

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムでは、産学連携による技術や産業の創出に寄与するため、川崎市、KISTECと連携し、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の開放利用を行っています。今後、4大学の機器を更に効果的にご利用いただくため、企業や大学の方を対象としたナノ・マイクロ技術講習・実習会『ナノファブスクエア』の個別チラシを順次掲載し開催して参りますのでご参加ください（NANOBIICオープンラボホームページ <http://open-labo.skr.jp/>）。

「NANOBIICオープンラボ」  
ホームページに随時掲載、  
開放利用機器の詳細仕様は  
機器一覧をご覧ください。



問合せ窓口：唐澤志郎 Tel：080-6560-3061/E-mail：[karasawa@newkast.or.jp](mailto:karasawa@newkast.or.jp)  
（地独）神奈川県立産業技術総合研究所  
※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金をご利用できます  
（URL：<http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000085717.html>）のでご相談ください。